(令和5年度)

一時立入者の管理区域立入記録

|  |  |
| --- | --- |
| 期間 | 　　年　　月　　日　　 ：　　　　〜　　　： |
| 許可者 | 印 | 立会者 | 印 |

* 許可者が一時立入者に同行して手続きを行う場合は印鑑不要とする。
* 許可者は「大阪大学核物理研究センターにおける放射線管理区域に一次的に立ち入る者への立入許可を与える者を指定する件（放射線安全委員会決定第２号）」で決められている者に限る。
* 許可者が立会う場合、立会者は不要とする。

教育訓練

|  |
| --- |
| □実施　□一年以内に同一目的で立ち入り、実施済み |

※許可者または立会者は一時立入者に教育訓練を行うこと。一年以内に同一目的で立ち入る場合は省略可能。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カード番号 | 氏名 | 所属 | 主な立入場所 | 線量計番号 | 被ばく線量 | 備考 |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カード番号 | 氏名 | 所属 | 主な立入場所 | 線量計番号 | 被ばく線量 | 備考 |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |
|  |  |  | AVF棟RI棟 リング棟 |  | μSv |  |